文章编号:0253-2239(2002)10-1275-04

# 硅基双势垒金属-绝缘层-金属-绝缘层-半导体 隧道发光结\*

# 唐洁影 刘柯林 聂丽程

(东南大学电子工程系微电子机械系统教育部重点实验室,南京 210096)

摘要: 讨论了硅基双势垒金属-绝缘层-金属-绝缘层-半导体(MIMIS)隧道发光结的结构、制备方法及发光特性。 所制备的样品最大发光亮度达到 1.9 cd/m<sup>2</sup>、光谱的峰值波长移到了蓝绿光区,表明双势垒 MIMIS 隧道发光结的 性能优于单势垒金属-绝缘层-半导体(MIS)隧道发光结。利用量子力学的共振隧穿效应对它作了较好的解释。 关键词: 金属-绝缘层-金属-绝缘层-半导体;双势垒;发光特性;共振隧穿 中图分类号:O482.31: TN383<sup>+</sup>.1 文献标识码:A

#### 1 引 言

硅基隧道发光结的基本结构为金属-绝缘层-半 导体(MIS)系统,当外加偏压后,电子隧穿绝缘层势 垒,隧穿电子将对界面附近金属中的电子气产生扰 动导致等离电磁振荡,产生表面等离体子,另一方 面,界面附近绝缘层中的原子在隧穿电子的影响下, 导致晶格的极化电磁振荡,产生表面电磁耦(合波) 子。在金属、绝缘层界面,两种振荡相互耦合,形成 表面等离电磁耦子。它是被束缚在界面上的,由它 产生的横电磁波是沿结平面方向传播的,由麦克斯 韦方程及边界条件,可得到不同界面处表面等离电 磁耦子的频率<sup>11</sup>。

表面等离电磁耦子波的波矢比同频率下介质中 传播的光子的波矢大,无法直接转变成光子发射出 来。必须经过一定的波矢补偿,才能同时满足动量和 能量守恒,使表面等离电磁耦子波转变成辐射光子。 在金属-绝缘层-半导体(简称 MIS)结构中引入一定粗 糙度可实现这种波矢补偿。在我们的制备工艺中,通 过 HF 酸腐蚀发光区,以得到所需的界面粗糙度。

MIS隧道发光器件无论是在器件结构还是工 作原理上与以前的发光器件有本质的不同,它具有 平面薄膜结构、发光电压较低、发光颜色可变、成本 低廉、可发射蓝绿光等特点,因而在平面彩色显示、 集成光学、光电通信等领域有着广阔的应用前景。

\* 国家自然科学基金(69576006)、东南大学科学基金 (9206001084)资助课题。

E-mail fjzeng@jlonline.com

收稿日期 2001-06-29; 收到修改稿日期 2001-11-08

自 1976 年 Lambe 和 MacCarthy<sup>[21</sup>在研究中首先 发现金属--绝缘层-金属隧道结的发光现象以来,国内 外许多学者从理论上和实验上对之进行了深入的研 究<sup>[3~9]</sup>。但是,目前国内外对硅基隧道发光结的研究 离实用化还有一定的距离,主要问题是发光强度较 弱,尤其是蓝绿光相对于红、黄光更弱。为此,我们对 MIS 结的结构进行了改进与优化 采用双绝缘层金属 -绝缘层-金属-绝缘层-半导体(简称 MIMIS)结构代替 单绝缘层 MIS 结构,提高了发光效率,特别是蓝绿光 得到了明显增强。

#### 2 硅基双势垒隧道发光结的结构与制备

硅基双势垒隧道发光结为 MIMIS 结构 ,图 1 给 出其结构示意图。





以 n 型 Si 单晶为衬底,掺杂浓度为 10<sup>21</sup> cm<sup>-3</sup>。 通过 920 ℃干氧氧化在 Si 表面形成 200 nm 厚的 SiO<sub>2</sub> 在厚 SiO<sub>2</sub> 上光刻出一定图形的发光区,再氧 化形成一层薄 SiO<sub>2</sub> 作为 MIMIS 结的第一绝缘层 (厚度选择 3 nm、4 nm、5 nm 几个参量 )。在厚 SiO<sub>2</sub> 上光刻出电极孔,蒸上 Al 作为负电极的引线压焊 区。在发光区的薄 SiO<sub>2</sub> 上蒸一层厚为 15 nm 左右 的 Al 作为中间金属层,Al 自然氧化 48 h,形成厚 3 nm左右的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 作为第二绝缘层。然后在样品 表面蒸厚为 10 nm 左右的 Ti 及厚为 500 nm 左右的 厚 Au,并刻去和腐蚀掉遮挡在 Al 电极和发光区域 上的厚 Au 及 Ti 层,厚 Au 膜作为阳极引线压焊区, Ti 作为 Au 与 SiO<sub>2</sub> 之间的粘联层,增加 Au 对 SiO<sub>2</sub> 的附着力。最后蒸一层 50 nm 左右的薄 Au 膜覆盖 在发光 区的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 层上,且与分布在发光区外围的 厚 Au 膜重合接触,作为 MIMIS 结的阳极。

# 3 发光特性测试

为了验证双绝缘层 MIMIS 结构的发光性能优 于单绝缘层 MIS 结构,我们对 MIMIS 样品的发光 亮度及发光光谱分别进行了测试,并且与以前制备 的 MIS 样品的测试结果<sup>[10]</sup>进行了比较。制备 MIMIS 样品时,我们使用了三块 3 英寸的 Si 片,对 第一绝缘层 SiO<sub>2</sub> 的厚度设计了 3 nm、4 nm 和 5 nm 三种参量,分别在三块 Si 片上实现。测试中,将样 品按所属硅片分为 A、B、C 三类(即对应的薄 SiO<sub>2</sub> 厚度分别为 3 nm、4 nm、5 nm),每一类样品有若干 个,按阿拉伯数字 1 2 3...编号。

 1)发光亮度采用 UBD1/4 型亮度计(Photo Research Division of Kollmorgen.cop),校准系数为
 3.01,分别对三个 C 类 MIMIS 器件的光亮度进行 了测量,测量结果如表 1 所示 表中同时给出了单势 垒 MIS 器件(5<sup>#</sup>)的测试结果。

sample	number	applied voltage	light-emission intensity
		/V	/( $cd/m^2$ )
MIMIS	C2	11.6	0.10
	C1	14.0	1.90
	C3	12.1	1.15
MIS	MIS $5^{\#}$	5.2	0.02

Table 1. Light-emission intensity of the samples

MIS 5<sup>#</sup> 样品为单势垒结构,其工作电压较低, 仅 5.2 V,而 MIMIS 器件为双势垒结构,能够承受 的外加偏压较高,达到十几伏。然而,C2、C1 和 C3 三个 MIMIS 样品来自同一块大 Si 片的不同位置, 由于实验条件的限制,其结构参量也会存在一定差 异,因此它们的工作电压也不尽相同。但是,从表 1 中看出,任何一个 MIMIS 样品的发光亮度都比 MIS 样品的发光亮度有了较大提高 ,表中 MIMIS 样品的最大发光亮度达到了 1.9 cd/m<sup>2</sup>。

#### 2)发光光谱

利用日本 Shimadzu 公司制造的 RF-5000 光谱 仪对多个 MIMIS 样品的发光光谱进行了测量 ,图 2 (a)图 (b)给出了两个 MIMIS 样品 B4、C2 的发光 光谱。两样品的薄 SiO<sub>2</sub> 厚度分别为 4 nm 和 5 nm 左右。



Fig.2 Luminescence spectra of the MIMIS samples. (a) Sample B4 (V=7 V); (b) Sample C2 (V=11.6 V)

从图 2 中看出 ,B4 样品的谱峰在 545nm 附近, 属绿光区 ,而 C2 样品的谱峰在 480 nm 附近,属蓝 光区。这可能是因为薄 SiO<sub>2</sub> 厚度的不同,使器件工 作电压不同,从而结中隧穿电子可获得的能量不同, 相应的光谱峰值波长也就不同。

为了便于比较,图 3 给出了 MIS 单势垒隧道发 光结典型的发光光谱曲线(光谱仪型号:SPEX 1403),主峰在 630 nm 附近。



Fig.3 Luminescence spectrum of MIS sample 16(V=6.5V) 显然,双势垒 MIMIS 隧道结的发光光谱中,蓝

#### 4 发光特性讨论

由发光特性测试结果可以看出,双势垒 MIMIS 结较单势垒 MIS 结发光亮度大为提高,发光光谱的 谱峰也向短波长(蓝光波长)方向移动,说明双势垒 结构的引入,使硅基隧道发光结的性能得以改善。 图 4 给出了 MIMIS 结的结构简图,为了便于分析 双势垒 MIMIS 结构光增强的机制,图 5 给出了与图

#### 4 所示结构相应的势垒结构模型。

	vacuum	$\epsilon_0$
$M_2$	top electrode	$\varepsilon_1$
$I_2$	insulating layer	$\boldsymbol{\varepsilon}_2$
$M_1$	metal layer	$\varepsilon_3$
$I_1$	insulating layer	$\epsilon_4$
S	semiconductor	$\varepsilon_5$

Fig. 4 Schematic diagram of MIMIS sample



Fig. 5 The potential barrier model of MIMIS sample

若图 5 所示系统外加直流偏压为 V(S 端接 $负),在绝缘层 I<sub>1</sub>、I<sub>2</sub> 两端的压降分别为 <math>V_1$ 、 $V_2$ ,那 么,系统在外加直流偏置下 S 区中的电子获得一定 的附加能量后成为  $E_F + eV_1(E_F$  为费米能量),这 样的电子沿 X 轴正方向运动 ,因绝缘层 I<sub>1</sub> 很薄 ,将 有部分电子通过热电子发射和隧道贯穿到达 M<sub>1</sub> 区,透射电子强度相关能量的分布  $T_1(E)$ 在图 S(c)中标出。设薄金属层 M<sub>1</sub> 为半透明 ,通过 M<sub>1</sub> 的电子 将与第二绝缘层作用 ,其结果可通过解定态薛定谔 方程得到。根据量子力学理论 ,对 I<sub>2</sub> 区域 ,当入射 电子能量小于势垒高度时 ,定态薛定谔方程的解为 指数衰减形式 ,但入射电子能量若大于势垒高度时 , 定态薛定谔方程的解应为振荡解形式。

现假设  $E_{\rm F} + eV_1 > \phi$  ,则  $M_1$ 、 $I_2$  和  $M_2$  和三个 区域定态薛定谔方程的解<sup>111</sup>可表示为

$$\psi_{M_1} = A_1 \exp(ikx) + A_2 \exp(-ikx),$$
  

$$\psi_{I_2} = B_1 \exp(i\beta x) + B_2 \exp(-i\beta x),$$
  

$$\psi_{M_2} = C_1 \exp(i\alpha x),$$
(1)

其中,

$$k^{2} = rac{2m_{1}^{*}(E - eV_{2})}{\hbar^{2}}$$
  
 $\beta^{2} = rac{2m_{2}^{*}(E - \phi)}{\hbar^{2}}$ ,

 $\alpha = \frac{2m_3^* E}{\hbar^2} ,$ 

 $m_1^*, m_2^*, m_3^*$ 分别表示  $M_1 \boxtimes I_2 \boxtimes M_2 \boxtimes P$ 电子的有效质量 E为电子的能量。

按照几率流密度公式

$$J = \frac{-\mathrm{i}\hbar}{m^*} \left( \psi^* \frac{\partial}{\partial x} \psi - \psi \frac{\partial}{\partial x} \psi^* \right),$$

可求出电子的入射、反射和透射密度  $J_{in}$ 、 $J_{ref}$ 和  $J_{tr}$ ,为简单起见 假设  $eV_2 \ll E$ ,有  $\alpha \approx k$  那么透射系数

$$T = \left| \frac{J_{\rm tr}}{J_{\rm in}} \right|^2 = \frac{4\beta^2 k^2}{(k^2 - \beta^2) \sin^2 \beta d_2 + 4\beta^2 k^2} , (2)$$

显然 ,当  $\beta d_2 = n\pi$ 时 ,T 值达到最大 ,近似为 1。这种 现象称为电子的隧穿共振。相应的电子能量呈分立 状态 ,其值为

$$E_n = \frac{\hbar^2 \beta^2}{2m_2^*} + \phi = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m_2^* d_2^2} n^2 + \phi , \quad (3)$$

这里将第二势垒的高度近似用它的平均值  $\phi$  代替 ,*n* 为整数。式中  $E = \phi$  代表电子的动能 ,也可表示为

$$E - \phi = \frac{p^2}{2m_2^*} = \frac{\hbar^2 \beta^2}{2m_2^*} , \qquad (4)$$

所以 $\beta = p/\hbar = 2\pi/\lambda$ , p为电子动量,  $\lambda$ 为德布罗意波 长,于是共振透射条件 $\beta d_2 = n\pi$ 可写为 $2d_2 = n\lambda$ 表 明在第二势垒区中来回反射的电子波在到达右沿 ( $I_2/M_2$ 界面)时都具有相同的相位,从而使透射波具

#### 有最大的强度。

据上分析表明 引入第二绝缘层后 只要满足一 定的条件 系统中的电子由于隧穿共振效应而透射 几率较大 能量发生分裂。透射强度关于能量的分布 T<sub>2</sub>(E)示于图5(c)中。显然系统中出现了单势垒 所不具备的透射率较大的高能量电子能级 单势垒 的透射电子强度相关能量的分布  $T_1(E)$  见图 5 (c)]这些能级上的电子经过系统各界面层时,能够 激发起高频率的表面等离电磁耦子 这就是双势垒 隧道结与单势垒隧道结相比 ,发射光谱中蓝绿光增 强的原因。比较  $T_1(E), T_2(E)$ 分布曲线, 双势垒 系统中隧穿电子的能量范围较单势垒系统大得多, 因此激发 表面等离电磁耦子的效率得到提高。同 时,第二绝缘层的引入,又使系统中金属-绝缘层界 面增多 相应的表面等离电磁耦子模式也会增加 ,当 然电子激发表面等离电磁耦子的效率也随之增加, 发光亮度将得以提高。

结论 1) 双势垒 MIMIS 隧道结的光谱特性优于单 势垒 MIS 隧道结,它的发光亮度大为提高,较单势 垒结提高了数十倍 且发光光谱的峰值波长向短波 方向移动 位于蓝绿光区。这使隧道发光结的研究 更具有应用前景。

2) 应用量子力学隧穿共振理论分析双势垒 MIMIS 隧道结的势垒模型,表明在一定条件下,双 势垒结构中存在分立的电子共振能级 增加了高能 量的隧穿电子。所以,通过适当选择各层膜的参量 可以很好地利用隧穿共振效应,提高隧道发光结的 发光效率 改善光谱特性。

#### 考 参 文 献

[1] Donohue J F, Wang E Y. Surface plasmon dispersion

analysis in the metal-oxide-metal tunnel diode. J. Appl. Phys. , 1987 , 62 (4):1313~1317

- [2] Lamb J, McMarthy SL. Light emission from inelastic electron tunneling. Phys. Rev. Lett. , 1976 , 37(14) 923~925
- [3] Kirtley J, Thesis T N, Tsang J C. Light emission from tunnel junctions on gratings. Phys. Rew. (B), 1981, 24 (10) 5650~5663
- [4] Soole J B D, Hughes H P. Roughness-coupled light emission from tunnel junction : The role of the fast surface plasmon. Surf. Science , 1988 , 197(2) 250~266
- [5] Znamensky D A, Yusupov R G, Mislavsky B V. Langmuir-Blodgett mono- and mutilavers of fluorocarbon amphophilic polymers and application in photogalvanic metal-insulator-semiconductor structure. Thin Solid Films, 1992, 219(1~2) 215~220
- [6] Sun Chengxiu, Zhang Youwen, Gao Zhonglin. Some improvement on the light emission properties of MIM tunneling junction system. Chinese J. Electronics ,1996,5 (1)  $44 \sim 48$
- [7] Zhang YW, Sun CX. Relation of roughness and emitting spectrun of metal/insulator/metal tunnel junction. Acta Electronica Sinica (电子学报), 1997, 25(5) 25~28 (in Chinese)
- [8] Yu J H, Sun C X. Electron tunneling and negative differential resistance of MIM light-emission tunnel junction. Acta Physica Sinica (物理学报),1998,47(2):  $300 \sim 306$  (in Chinese)
- [9] Wang M X, Sun C X. Research of electron resonant tunneling and light emission properties of double-barrier tunnel junction. Acta Physica Sinica (物理学报), 1999, 48(2) 326~331
- [10] Yu Jianhua. The Research of the Light Emission Performance and the Current-Voltage Characteristic of Si-Based MIS Tunnel Diode( 硅基 MIS 隧道发光二极管 的发光性能和电流-电压特性研究) [ doctorial Dissertation ], Nanjing: Southeast University, 1999, 52 54 (in Chinese)
- [11] Hui Hexing. Quantum Mechanics (量子力学). Beijing: Beijing University of Science and Engineering Press, 1995.  $64 \sim 72$  (in Chinese)

# The Si-Based Double Barrier Tunneling Light Emitting Junction

Tang Jieving Liu Kelin Nie Licheng (Key Laboratory of Micro-Electro-Mechanical-Systems of Education Ministry of China, Department of Electronic Engineering ,Southeast University, Nanjing 210096) (Received 29 June 2001; revised 8 November 2001)

Abstract: The structure, fabrication technology and light-emission properties of double barrier MIMIS tunneling junction are discussed. It shows better characteristics in comparison with MIS junction. The maximal luminance of the MIMIS devices is  $1.9 \text{ cd/m}^2$ , and their spectrum peak appears in the blue area. The phenomena can be well explained according to resonant tunneling theory.

Key words : metal-insulator-metal-insulator-semiconductor (MIMIS); double barrier; lightemitting characteristics; resonant tunneling